



Очистка аргона от примесей (паров воды, кислорода, азота, и т.д.)

Установка очистки аргона AGP от Компании Focused Photonics Inc – это:

Удобный дизайн, малый объём и малый вес, лёгкий запуск и управление, низкое потребление энергии.

Высокая чистота получаемого газа. Это достигнуто главным образом за счёт оптимальной конструкции реактора. В устройстве используются чистые благородные металлы и нано-размерные технологии,

что позволило отойти от традиционной колонной конструкции. Это революционный шаг в очистке аргона.

Высокая активность катализатора, обеспечивающая низкую рабочую температуру и высокую степень очистки аргона.

Глубокая очистка аргона от азота. Используется многостадийный процесс, включающий механическую фильтрацию, химический катализ и т.д. При чистоте получаемого аргона 99.9999 % содержание в нём азота не более 0,1 мг/л (ppm).



Система IRS - регенерация реактора очистки аргона выполняется путем нажатия всего лишь одной кнопки. В процессе регенерации устройство обеспечивает подачу высокочистого аргона в

нормальном режиме, без использования водорода и отключения питания. Этот процесс безопасен и надёжен.

Вход и выход аргона снабжены пористыми фильтрами (диаметр пор менее 6 мкм).

Для обеспечения высокой чистоты выходящего очищенного аргона в устройстве использованы трубопроводы из высококачественной нержавеющей стали и клапаны с электрохимической полировкой внутренних и внешних поверхностей.

Для подключения различных типов приборов по отдельному заказу предоставляется широкий выбор переходных элементов (адаптеров).

Низкая интенсивность отказов обеспечена искусственным старением электронных компонентов.

Принцип действия установки очистки аргона AGP - FPI

Устройства для глубокой очистки инертных газов в аргоне, использующие принцип каталитического связывания и поглощения присутствующих в нём примесных газов (O₂,

N₂, CO, CO₂, H₂O и др.). Такой высокочистый аргон используется в оптико-эмиссионной и масс-спектрометрии, газовой хроматографии, в качестве защитной среды при производстве прецизионных сплавов, полупроводников, в атомной энергетике и т.д. С помощью станции очистки аргона APG, обычный (ординарный) газ может быть очищен до концентрации 99,9999 %.

Применения установки очистки аргона APG - FPI

Аргон является наиболее доступным и дешёвым среди инертных газов. Благодаря высокой плотности, низкой теплопроводности и химической инертности аргон широко используется в научных исследованиях, металлургии, электронной промышленности, изготовлении осветительных приборов, химической промышленности, атомной энергетике и других областях.

В частности, аргон высокой чистоты необходим для работы оптико-эмиссионных и масс-спектрометров, газовых хроматографов, в производстве специальных ламп, полупроводников, редких металлов и т.д.

Газ	Чистота (%)	N ₂ (ppm)	O ₂ (ppm)	CO (ppm)	CO ₂ (ppm)	CH ₄ (ppm)	Точка росы
Входящий (ординарный)	99,95	< 106	< 15	< 5	< 5	< 5	-65 °C
Выходящий (очищенный)	99,9999	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	-85 °C

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=h4f8iipM1pk

Характеристики

Модель	AGP - I	AGP - II
Входное давление	0,2 ~ 1 МПа	
Производительность	1 ~ 4 м ³ /час	4 ~ 10 м ³ /час
Стандарт тестирования	GB/T4842-2006	
Питание	АС 220 В, 50 Гц	
Потребляемая мощность	2,2 кВт	
Габариты	500 × 500 × 900 мм	
Вес	48 кг	65 кг